

掃描探針顯微儀

Scanning Probe Microscope

【儀器原理及功能】

1. 接觸式原子力顯微(Contact Mode AFM)
2. 輕敲式原子力顯微鏡(Tapping Mode AFM)
3. 非接觸式原子力顯微鏡(Non-Contact Mode AFM)
4. 側向力原子力顯微鏡(LFM, Lateral Force Microscope)
5. 導電性原子力顯微鏡(CAFM, Conducting Atomic Force Microscope)
6. 相位型輕敲式原子力顯微鏡(Phase/Frequency Feedback Tapping Mode AFM)
7. 磁力顯微鏡(MFM, Magnetic Force Microscope)
8. 電力顯微鏡(EFM, Electrical Force Microscope)
9. 力調變顯微鏡(FMM, Force Modulation Microscope)
10. 掃描表面電位顯微鏡(SSPM, Scanning Surface Potential Microscope)

【儀器說明】

購置日期：96年7月25日

經費來源：校務基金

購價：5,800,000元

【服務項目】

一般服務項目：材料表面奈米級光電特性量測

【申請辦法】

直接與連絡人接洽

【樣品準備須知】

1. 需盡可能降低樣品表面之污染
2. 樣品平面尺寸 < 8吋晶圓
3. 樣品表面最大高低落差 < 5 μm
4. 樣品高度 < 2 cm

【收費標準】

僅開放委託操作，2500元/hr

【連絡人】

陳思翰

TEL:05-2717992

E-mail: shchen@mail.ncyu.edu.tw

【儀器室地點】

應物二館A18B-107

【使用準備須知】

送件單位需有陪同人員，此可提高量測之效率

掃描探針顯微儀 Scanning Probe Microscope



Scanning Probe Microscope